**五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 09：30  |  12：30 | Oxford ICP-RIE(卓越)  (最少2人，上限3人)  5/6訓練  5/27檢定 | 9:30-10:30  橢偏儀(卓越)  5/7訓練  5/14檢定 | PECVD(卓越)  5/8[練習]  5/22[練習] | Karl Suss Aligner MA6(卓越)  (含Spin Coater)  5/9訓練  5/16檢定 | 11:00-12:00  SEM+EDS  (卓越)  5/17[練習]  5/24[練習] |
| 雷射共軛聚焦顯微鏡(卓越)  5/6訓練  5/13檢定 | 10:30-11:30  RTA(卓越)  5/7訓練  5/14檢定 |  | E-Gun氧化物及金屬(卓越)  5/23訓練  5/30檢定 |  |
| Samco ICP(卓越)  5/20[練習] | Karl Suss Aligner MA8 (卓越)  (含Spin Coater)  5/21訓練  5/28檢定 |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 下午 | 14：00  |  17：00 | PECVD(卓越)  (最少3人，上限5人)  5/6 訓練  5/27 檢定 | 13：00-17：00  5/7  實驗室一般訓練  (應力**231**室)  (上限20人) | 5/8  卓越大樓  安全訓練 | SEM+EDS  (卓越)  5/9訓練  5/30檢定 | 14:00-15:00  O2 Descum\_  Photoresist  (卓越)  5/10訓練  5/17檢定 |
| Samco ICP(卓越)  (最少2人，上限3人)  5/6訓練  5/27檢定 | 14:00-16:00  PECVD(卓越)  5/14 [練習]  5/21 [練習] | SEM+EDS  (卓越)  5/15[練習]  5/22[練習] | Sputter(卓越)  5/9訓練  5/16檢定 | 15:00-17:00  Samco ICP(卓越)  5/10[練習]  5/17[練習]  5/24[練習] |
| 14:00-16:00  PECVD(卓越)  5/13 [練習]  5/20[練習] | 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  5/14[練習]  5/21[練習] | 17:00-18:00  Samco ICP(卓越)  5/15[練習]  5/22[練習] | 14:00-16:00  PECVD(卓越)  5/23 [練習] |  |
| 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  5/13[練習]  5/20[練習] | SEM+EDS  (卓越)  5/28[練習] |  | 16:00-18:00  Oxford ICP-RIE  (卓越)  5/23[練習] |  |
|  |  |  |  |  |